

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 6 部門第 1 区分  
【発行日】令和 6 年 7 月 23 日(2024.7.23)

【公開番号】特開 2022-31172(P2022-31172A)  
【公開日】令和 4 年 2 月 18 日(2022.2.18)  
【年通号数】公開公報(特許)2022-030  
【出願番号】特願 2021-123818(P2021-123818)  
【国際特許分類】

G 0 1 N 2 5 / 2 0 ( 2 0 0 6 . 0 1 )

10

【 F I 】

G 0 1 N 2 5 / 2 0                      A

【誤訳訂正書】  
【提出日】令和 6 年 7 月 12 日(2024.7.12)  
【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

20

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

熱分析による、センサによる材料試料の測定の方法であって、前記材料試料が、あらかじめ決定され、前記測定を実施するための準備処置が、第 1 の場所において、自動的に誘導される操作員 - 機械対話によって実行され、次いで、前記測定が、あらかじめ決定された測定プログラムを実行する間に、測定装置によって自動的に前記第 1 の場所において行われ、

前記測定により 1 つの測定曲線を取得し、前記測定曲線を複数の測定曲線区間に分け、前記測定装置のサブユニットの影響の領域が割り当てられた前記測定曲線区間を、前記測定曲線区間に関係付けられる基準値および / または基準経路と、少なくとも部分的に自動的に比較をすることにより、1 つまたは複数の偏差が決定され、

30

前記偏差から、少なくとも部分的に自動的に、前記サブユニットのうちの 1 つまたは複数の機能的状態の、前記決定された偏差についての前記サブユニットのそれぞれの目標状態からの偏差の形式で存在する、起こりうる原因となる干渉源の選択がなされる、方法。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の方法であって、

ファイルが自動的に編集され、前記ファイルは、少なくとも、前記測定曲線、および / または、前記可能性のある干渉源を含み、前記第 1 の場所から遠隔の第 2 の場所へ送信され、さらなる評価に対して利用可能にされる、方法。

【請求項 3】

40

請求項 2 に記載の方法であって、

前記ファイルは、前記測定装置、および / または、前記測定装置のサブユニットの、識別データおよび / または特性に関する情報を追加的に内包し、任意選択で、前記測定の間、前記測定装置の時間プロファイル、前記第 1 の場所の識別情報、前記第 1 の場所において実施される前記測定の前記測定曲線および / または測定ログを含む、方法。

【請求項 4】

請求項 2 または 3 に記載の方法であって、

前記自動的に誘導される操作員 - 機械対話、実行される前記測定、および / または、前記ファイルの前記編集の間、工程に影響を及ぼす、および、前記第 2 の場所から発出する処置は行われない、方法。

50

## 【請求項 5】

請求項 2 から 4 のいずれか一項に記載の方法であって、

前記第 1 の場所において、前記自動的に誘導される対話、前記測定を前記実行すること、および / または、前記ファイルの前記編集を制御する電子プラットフォームへの、前記第 2 の場所から発出するアクセス選択肢は存在しない、方法。

## 【請求項 6】

請求項 2 から 5 のいずれか一項に記載の方法であって、

前記第 1 の場所において、前記測定装置の検査が、前記第 2 の場所において前記ファイルを受け取った人物に対する、前記第 1 の場所への輸送の手段の提供の後に続いて、少なくとも部分的に手作業で行われる、方法。

10

## 【請求項 7】

熱分析による、センサによる材料試料の測定のための測定装置上で実行されるときに、請求項 1 から 6 のいずれか一項に記載の方法のために前記測定装置を制御する、制御ソフトウェア。

## 【請求項 8】

センサによる材料試料の測定のためのデバイス、熱分析器であって、請求項 7 に記載の制御ソフトウェアを伴い、ならびに / または、請求項 1 に記載の方法の前記操作員 - 機械対話を誘導するための制御器、および、請求項 1 に記載の方法の前記測定プログラムを実行する測定装置を伴い、前記制御器は、請求項 1 に記載の方法による、前記測定曲線区間の前記比較、および / もしくは、前記選択を前記なすことに関与させられ、ならびに / または、請求項 2 に記載の前記ファイルを編集する、デバイス。

20

## 【請求項 9】

請求項 8 に記載のデバイスであって、

前記制御器は、請求項 2 から 6 のいずれか一項に記載の方法を実施するために前記デバイスを制御することができる、デバイス。

## 【請求項 10】

あらかじめ決定された測定プログラムを実行するために設計される測定装置と、制御器とを用いた、熱分析による、センサによる材料試料の測定のためのシステムであって、

前記制御器は、自動的に誘導される操作員 - 機械対話の実施の後に続いて、前記あらかじめ決定された測定プログラムによって前記測定を実施するように、前記測定装置を制御し、

30

前記測定により 1 つの測定曲線を取得し、前記測定曲線を複数の測定曲線区間に分け、前記測定装置のサブユニットの影響の領域が割り当てられた前記測定曲線区間を、前記測定曲線区間に関係付けられる基準値および / または基準経路と、少なくとも部分的に自動的に比較をすることにより、1 つまたは複数の偏差を決定し、

前記偏差から、少なくとも部分的に自動的に、前記サブユニットのうちの 1 つまたは複数の機能的状態の、前記決定された偏差についての前記サブユニットのそれぞれの目標状態からの偏差の形式で存在する、起こりうる原因となる干渉源の選択を行うように設計される、システム。

## 【請求項 11】

40

請求項 10 に記載のシステムであって、

前記システムの前記制御器は、請求項 2 から 6 のいずれか一項に記載の方法を実行するように設計される、システム。